



NU-261 段差計

小坂研究所 ET200A

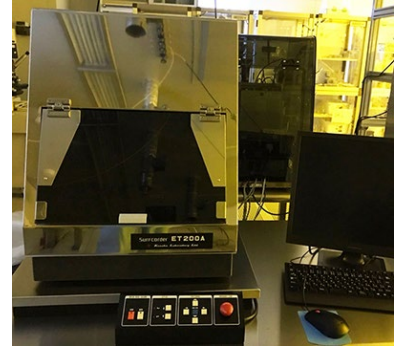
登録ファイル



無し

単独で登録するファイルはありませんが、**以下の対象装置で成膜、エッチングを行った後に本装置を使用した場合は、対象装置のPDLに測定した数値を入力してください**

また**対象装置のRDEデータ登録の画面上で「基本情報」の「説明」欄に、「NU-261 段差計で○○を測定」の一文を入れて下さい。**



RDEデータ登録画面

基本情報

記入年月日 2026-02-13 JST

装置 **必須** 装置を選択してください。

データ投入者(所属) HATA, Chiharu (名古屋大学)

データ所有者(所属) **必須** HATA, Chiharu (名古屋大学)

データ名 **必須** データ名を入力してください。
basic/fileName

実験ID 実験IDを入力してください。
basic/experimentId

説明 説明を入力してください。
basic/description

【対象装置】

NU-205	3元マグネトロンスパッタ装置	
	島津製作所 HSR-522	
NU-213	8元マグネトロンスパッタ装置	
NU-221	プラズマCVD装置	サムコ PD-240
NU-224	電子ビーム蒸着装置	アルバック EBX-10D
NU-225	ICPエッチング装置	アルバック CE-300I
NU-226	RIEエッチング装置	サムコ RIE-10NR
NU-232	原子層堆積装置	サムコ AD-100LE
NU-234	ICPエッチング装置	サムコ RIE-200iPN
NU-245	スパッタリング装置	キャノンアネルバ E-200S
NU-262	プラズマ誘起CVD装置	サムコ PD-220N
NU-267	RIEエッチング装置	サムコ RIE-10NR



お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2026/02/13